

<i>Багмут А.Г., Косевич В.М., Шипкова И.Г., Жучков В.А., Олейник Е.Е.</i> Ориентационные соотношения и ферромагнетизм при трансформации кристаллической решетки лазерных конденсаторов Ni	5
<i>Погребняк А.Д., Береснев В.М., Комаров Ф.Ф., Ильяшенко М.В., Ердьбаева Н.К., Кирик Г.В., Тюрин Ю.Н., Колисниченко О.В., Шипиленко А.П., Углов В.В., Тулеушев Ю.Ж., Турбин П.В.</i> Многокомпонентные, нанокompозитные покрытия на основе TI-SI-N, их структура и свойства ...	14
<i>Gorbachyov L.A., Pogrebnyak A.D.</i> Study of structure and physico-chemical and mechanical properties in low-carbon steel after cyclic loading	23
<i>Лопухов Ю.И.</i> Формирование структуры хромоникелькремнистой стали в условиях газoeлектрической дуговой наплавки	28
<i>Казаченко В.П., Семченко Н.И., Попов А.Н.</i> Структура покрытий, сформированных последовательным нанесением наноразмерных слоев титана и углерода	32
<i>Тюрин Ю.Н., Погребняк А.Д., Колисниченко О.В.</i> Сравнительный анализ эффективности кумулятивно-детонационного и HVOF устройств для газотермического напыления покрытий	39
<i>Кунченко Ю.В., Кунченко В.В., Картмазов Г.Н.</i> О глубине зоны модификации свойств (упрочнения) материалов облучением при $T \leq 100$ °C низкоэнергетической плазмой тлеющего разряда	46
<i>Хороших В.М., Комарь А.А., Бровина М.А.</i> Об эффективности вакуумно-дуговых источников плазмы с сепарацией капельной фазы эрозии катода	54
<i>Покладок Н.Т., Григорчак І.І., Попович Д.І.</i> Гібридні мезо//нано масштабовані структури з почерговими напівпровідниковими і магнітоактивними зонами: формування та магніто-імпедансний відгук	60
<i>Бугаев Е.А.</i> Создание градированного многослойного покрытия Co/C для изображающей системы в диапазоне “углеродного окна” ($\lambda \sim 4,4 - 5,0$ нм)	69
<i>Белоус В.А., Леонов С.А., Носов Г.И., Хороших В.М., Ломино Н.С., Толмачева Г.Н., Бровина М.А., Ермоленко И.Г.</i> Модификация поверхности сплава Э110 осаждением многослойных Zr/ZrN покрытий и ионным облучением	76
<i>Удовицький В.Г.</i> Дослідження спектру оптичного поглинання та ширини забороненої зони високоорієнтованих тонких плівок дигідродибензотетраазаанулену	82
<i>Павлов А.М.</i> О димере гелия	87
<i>Столбовой В.А.</i> Вакуумно-дуговое распыление поверхности подложки ионами хрома и молибдена	90

<i>Алимов Н., Акбаров К., Абдуллаев К., Дадажонов Х., Отажонов С.М., Отажонова Д., Рахмонкулов М.</i> Оптическая спектральная память в пленочной гетероструктуре p-CdTe-SiO ₂ -Si	96
<i>Султонов Ш.Д., Юлдашев Н.Х.</i> Влияние циклических деформаций на электрофизические характеристики поликристаллических пленок (Bi _{0,3} Sb _{0,7}) ₂ Te ₃	99
<i>Лучанинов А.А., Омаров А.О., Стрельницкий В.Е., Снежко Д.В., Рожницкий Н.Н.</i> Электроды с алмазоподобным покрытием для электрохимических и электрохемилю-минесцентных исследований	104
<i>Горбачев Л.А., Погребняк А.Д.</i> Исследования твердости и физико-химических свойств структурных составляющих стали при циклическом деформировании	110
<i>Бурый И.П., Воробьев С.И., Однодворец Л.В.</i> Тензорезистивные свойства пленочных материалов на основе Ni и Mo или Cr	115
<i>Атакулов Ш.Б., Отажонов С.М., Расулов Р.Т., Розиюнова Н., Илхомхужаева Х.</i> Термоэлектрическая эффективность пленок теллурида свинца при легировании элементами V группы	119
<i>Султонов Ш., Юлдашев Н.</i> Роль внутренних механических напряжений в формировании деформационных характеристик поликристаллических пленок p-(Bi _{0,5} Sb _{0,5}) ₂ Te ₃	123
<i>Лапшин В.И.</i> Влияние стрикционной нелинейности на поверхностные волны в неоднородных полупроводниках	130
<i>Кунченко Ю.В., Кунченко В.В., Картмазов Г.Н., Белоус В.А., Толмачева Г.Н.</i> Влияние нестабильного, низкоэнергетического тлеющего разряда на свойства облучаемых материалов в процессе вакуумно-дугового осаждения покрытий	133
<i>Дроздов А.Н., Вус А.С., Пуха В.Е., Пугачев А.Т.</i> Влияние концентрации примеси на соотношение интенсивностей рентгеновских отражений от кристаллов металлофуллеренов	142
<i>Лапшин В.И.</i> Плазмон-поляритонные поверхностные волны в неоднородных полупроводниковых структурах	148
<i>Овруцкий А.М., Прохода А.С.</i> О термодинамическом аспекте кристаллизации аморфных металлов	152
<i>Персоналії</i>	158
<i>Правила оформления рукописей</i>	159
<i>Правила оформлення рукописів</i>	160
<i>Information for authors</i>	161